

## 堀場雅夫賞について

堀場雅夫賞は、国内外の大学または公的な試験研究機関において、分析・計測およびその応用に関する科学技術分野で顕著な業績を挙げつつある研究者・技術者を奨励表彰するものです。

## 対象分野

半導体製造プロセスにおける先端分析・計測技術



## 堀場雅夫賞受賞



京都大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻  
助教

占部 継一郎 氏

### 【受賞研究題目】

レーザー干渉計によるプラズマ電子密度計測の高速・高精度化



名古屋大学大学院 工学研究科 プラズマナノ工学研究センター  
助教

堤 隆嘉 氏

### 【受賞研究題目】

高精度半導体プラズマプロセスのための基板温度計測システムの開発



産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター  
主任研究員

布村 正太 氏

### 【受賞研究題目】

半導体プラズマプロセス中の薄膜材料の欠陥検出

## 特別賞受賞



ルール大学ボーfum プラズマ原子物理学科  
上席研究員

ツァンコ ヴァスコフ ツァンコフ 氏

### 【受賞研究題目】

イオンの速度分布関数による非侵襲的プラズマ特性解析

**審査委員会** (敬称略, 順不同)

審査委員長	金山 敏彦	産業技術総合研究所 特別顧問
海外審査委員	Srini Raghavan	Professor, Materials Science and Engineering, Chemical and Environmental Engineering, University of Arizona
審査委員	白谷 正治	九州大学大学院 システム情報科学研究院長 主幹教授
	寺本 章伸	東北大学 未来科学技術共同研究センター 教授
	渡邊 健夫	兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 所長 教授
	井上 正規	株式会社 堀場エステック 開発本部 研究開発部 部長
	藤井 哲雄	株式会社 堀場エステック 事業戦略室

